

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/008853 A1

(51) 国際特許分類: H01T 4/12

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009958

(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 13 日 (13.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-198667 2003 年 7 月 17 日 (17.07.2003) JP  
特願2004-065728 2004 年 3 月 9 日 (09.03.2004) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱マ  
テリアル株式会社 (MITSUBISHI MATERIALS COR-  
PORATION) [JP/JP]; 〒1008117 東京都千代田区大手  
町一丁目 5 番 1 号 Tokyo (JP).

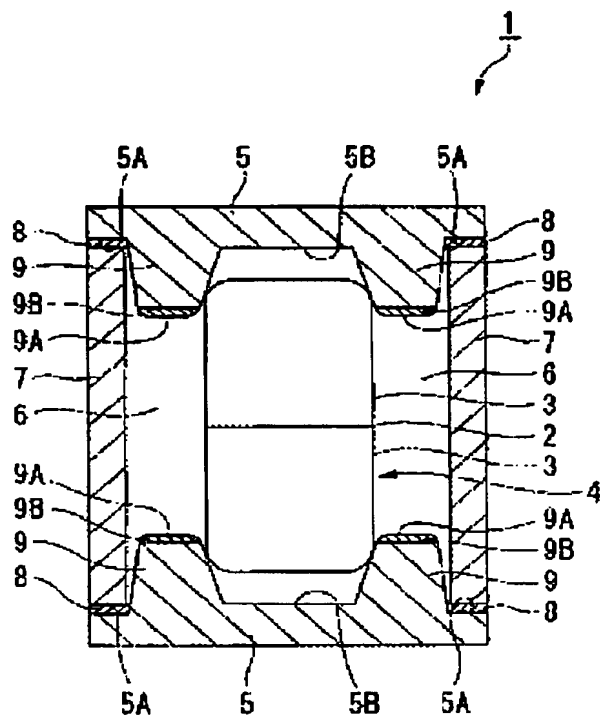
(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 社藤 康弘  
(SHATO, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒3688502 埼玉県秩父郡  
横瀬町大字横瀬 2 2 7 0 番地 Saitama (JP). 尾木 剛(OGI, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒3688502 埼玉県秩父郡横  
瀬町大字横瀬 2 2 7 0 番地 Saitama (JP). 足立 美紀  
(ADACHI, Miki) [JP/JP]; 〒3110102 茨城県那珂郡那  
珂町向山 1 0 0 2-1 4 Ibaraki (JP). 李 成圭 (LEE,  
Sung-gyoo) [JP/JP]; 〒3110102 茨城県那珂郡那珂町向  
山 1 0 0 2-1 4 Ibaraki (JP). 栗原 卓 (KURIHARA,  
Takashi) [JP/JP]; 〒3688502 埼玉県秩父郡横瀬町大  
字横瀬 2 2 7 0 番地 Saitama (JP). 植田 稔晃 (UEDA,  
Toshiaki) [JP/JP]; 〒3110102 茨城県那珂郡那珂町向  
山 1 0 0 2-1 4 Ibaraki (JP).(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,  
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,  
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,  
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可  
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

/続葉有/

(54) Title: SURGE ABSORBER

(54) 発明の名称: サージアブソーバ

(57) Abstract: A surge absorber in which an oxide layer excel-  
lent in chemical stability in the high temperature range and ex-  
cellent in adhesion to main discharge electrodes is deposited on  
the main discharge electrodes. The surge absorber comprises a  
cylindrical ceramic body (4) on which conductive films (3) sepa-  
rated by a discharge gap (2) are formed, a pair of main discharge  
electrode members (5) oppositely disposed at both ends of the  
cylindrical ceramic body (4) and in contact with the conductive  
films (3), and a tubular ceramic body (7) in which the paired main  
discharge electrode members (5) are opposed, the cylindrical ce-  
ramic body (4) is contained, and a filling gas (6) is sealed. Each  
of the paired main discharge electrode members (5) has a project-  
ing support (9). The opposed surfaces of the projecting supports  
(9) serve as main discharge surfaces (9A). Oxide films (9B) are  
formed on the main discharge surfaces (9A) by oxidation.(57) 要約: 高温領域で化学的安定性に優れ、かつ主放  
電電極に対する付着力の優れた酸化物層が被覆された  
サージアブソーバを提供すること。放電ギャップ2を  
介して導電性被膜3が分割形成された円柱状セラミッ  
クス4と、円柱状セラミックス4の両端に対向配置され導  
電性被膜3に接触する一対の主放電電極部材5と、一対  
の主放電電極部材5を対向するように配して円柱状セラ  
ミックス4を内部に封止ガス6と共に封止する筒型セラ  
ミックス7とを備え、一対の主放電電極部材5の少なく  
とも突出支持部9の対向する面である主放電面9Aに酸  
化処理による酸化膜9Bが形成されている。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。